

MSP-12 in

マグネトロンスパッタ

大面積マグネトロンスパッタ装置

- 12インチウェハに対応する大面積試料ステージを搭載。
- コーティング電圧 500V 以下でイオンダメージを軽減するマグネトロン方式を採用。
- オートコーティング機能で脱ガスから雰囲気ガス導入・コーティングまで全自動。
- 試料の出し入れが簡単な前方スライド式試料ステージを搭載。
- Ag ターゲットを装着すれば、透明フィルムなどの光沢処理も簡単に可能。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5 Tel; 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特 徵 · 仕 様

<u>特</u>徵

- ★ MSP-12in は SEM 観察または光沢膜作製用イオンスパッタ成膜装置です。
- ★ 大面積ターゲットを使用。マグネトロン電極は、強力磁石と磁極リングの組み合わせ によりターゲット金属表面に沿って外周から中心方向に磁場を作りターゲット全面 を有効に利用できます。ステージ全域のコーティング厚さムラは10%以下。
- ★ スパッタ雰囲気ガスは、空気またはアルゴンを用います。空気導入の際に膜純度を高める(低抵抗値・高光沢)ために雰囲気ガスの流量を制限するバイパス管を搭載。
- ★ 低電圧でコーティングすることにより、デリケートなサンプルに用いても試料損傷 がほとんどありません。
- ★ AUTO コーティングモードを装備。排気スタート・脱ガス・雰囲気ガス導入・コー ティングまで全自動で完了します。
- ★ 試料ステージはサンプルの出し入れが簡単な前方スライド試料ステージを採用。
- ★ 排気系は RP (100ℓ/min)。クリンルーム内でご使用される場合はスクロールポンプ (オプション) に変更する事も可能です。

仕 様

- 1. ターゲット : 直径 300mm マグネトロン型
- 2. 成膜対象金属 : Pt (標準) オプション (Au・Au-Pd・Pt-Pd・Ag)
- 3. 試料ステージ : 直径 300mm
- 4. ターゲット-試料間隔 : 40mm
- 5. チャンバーサイズ : 内径 330mm x 深さ 80mm
- 6. イオン化電圧/電流 : DC 0~500V/ 0~1A 電流計読み取り
- 7. タイマー : 0~1,2,3,12,30/sec, min, hr 各自由設定. 電子タイマー
- 8. 排気系 : 床置き $RP(100\ell/min)$ 、オプションにてスクールポンプに変更可。
- 9. 到達真空度: 0.5 Pa 以下
- 10. 真空度測定 : ピラニゲージ
- 11. 雰囲気ガス導入 : アルゴン又は窒素,空気をニードルバルブ調節、電磁バル
 - ブ+バイパス排気管 ON/OFF 方式
- 12. 安全対策 : サーキットプロテクタスイッチ、及び系統別フューズ付
- 13. 装置サイズ : 本体 W449mm×H427mm×D439mm 30kg
- 14. 電源 : 単層 AC 100 V, 15A アース線付 3 芯プラグ使用

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。